



公 告

下記のとおり、企画競争を実施します。

記

1. 件名：

「エレクトロスプレー・デポジション法による有機半導体薄膜形成技術」の模型製作

2. 内容：

独立行政法人理化学研究所（以下、「理研」という。）は、理解増進活動の一環として、「nano tech 2010 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」へ出展するにあたり、理研の研究成果を具体化した模型制作を行う。今回、「エレクトロスプレー・デポジション法による有機半導体薄膜形成技術」の模型制作会社を選定するため、企画競争を行う。

3. 企画競争に参加する者に必要な資格：

- ① 上記「2.内容」に示す業務の実施が可能な者であること。
- ② 平成21年度における独立行政法人理化学研究所競争契約参加資格又は国の競争参加資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、「物品の製造」、「物品の販売」または「役務の提供等」の資格を有する者であること。
- ③ 独立行政法人理化学研究所から物品購入等契約に係る取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

4. 諸条件：

別紙「独立行政法人 理化学研究所 「エレクトロスプレー・デポジション法による有機半導体薄膜形成技術」の模型製作 に関する企画競争要領」のとおり。

※ 上記資料は独立行政法人理化学研究所（和光本所（埼玉県和光市広沢2番1号研究本館3階）契約第1課）でお渡しします。

5. 応募書類提出期限、提出場所：

提出期限：平成21年12月10日（木） 15：00まで

提出場所：独立行政法人理化学研究所 広報室

（埼玉県和光市広沢2番1展示事務棟2階）担当：林

TEL048-467-9272 Fax048-462-4715

6. 審査方法：

「エレクトロスプレー・デポジション法による有機半導体薄膜形成技術」の模型製作企画選考委員会において提出書類に基づき審査を行うこととする。

審査基準は別紙「エレクトロスプレー・デポジション法による有機半導体薄膜形成技術」の模型製作 書類審査基準を参照。

7. スケジュール：

平成 21 年 11 月 26 日：受付開始

平成 21 年 12 月 1 日：質問受付締切

平成 21 年 12 月 10 日：提出書類締切

平成 21 年 12 月 17 日：選定結果通知

8. 結果通知：

E-mail、又は FAX にて通知する（お電話でのお問い合わせはご遠慮ください）。

9. 留意事項：

- ・ 本企画競争に応募するにあたって必要な経費は、提案者の負担とする。
- ・ 本企画競争への応募書類等は返却しない。

以上